多段階化学気相成長法を用いたバナジウム硫化物薄膜の作成

Preparation of Vanadium sulfide thin films grown by multi-step chemical vapor deposition process

阪大産研¹, 関大システム理工², 物材機構³

平尾成¹, 山本 真人², 若山裕³, 田中 秀和¹

ISIR, Osaka Univ.,¹, Kansai Univ.,², NIMS³

Akira Hirao¹, Mahito Yamamoto², Yutaka Wakayama³, Hidekazu Tanaka¹

E-mail: hirao77@sanken.osaka-u.ac.jp

遷移金属と S, Se, Te の 16 族元素が 1 : 2 の比率で結合している遷移金属ダイカルコゲナイド (TMDC) は多くが層状構造をしており、原子層の形態で多彩な物性を示すことで知られている。例えば単層二硫化モリブデン (MoS₂) は直接半導体として機能し、二硫化バナジウム (VS₂) は室温強磁性が理論予測され、水熱合成法によりそのナノシートの合成と強磁性の観測が報告された[1]。近年、均一かつ大面積での TMDC 薄膜を合成する方法として、モリブデン酸化物薄膜を前駆体として硫黄雰囲気中で MoS₂ 薄膜へと転換する「多段階化学気相成長法」が報告され[2]、FET 作成が報告されている[3]。

本研究では、良質な薄膜結晶を作成可能なパルスレーザー蒸着 (PLD) 法により作成された VO₂ 薄膜を前駆体として用い、多段階化学気相成長法により、バナジウム硫化物薄膜の合成を試みた。PLD 法で Al₂O₃(0001) 基板上に VO₂ 薄膜(30nm)を形成し、硫黄飽和雰囲気において、550°C~900°C と順次昇温することにより硫化処理を行った。Fig.1 に硫化過程におけるラマンスペクトル (励起波長 532nm) を示す。550°C 以上の硫化処理で、VO₂ 由来の構造が消失し新しいピーク構造 (213cm⁻¹ および 500cm⁻¹) が出現した。また X 線構造回折においても 2θ=36.08 度に硫化に伴う新しい回折ピークが観測された (Fig. 1 挿入図)。電気伝導特性においては、VO₂ 薄膜に見られた 67°C 付近の金属絶縁体相転移は完全に消失し (Fig. 2 挿入図)、高温領域と低温領域で活性化エネルギーが大きく異なる半導体的な挙動が観測され、新たな物質相が得られたと考えられる (Fig. 2)。当日は得られた物質相の同定および詳細な性質も含めて報告する。

References

- [1]. D. Gao *et al*, J. Mater. Chem. C., 1(2013), 4, 5909-5916
- [2]. S. N. Heo, Y. Ishiguro, R. Hayakawa, T. Chikyow, and Y. Wakayama, APL Mater., 4 (2016) 030901
- [3] S. Heo, R. Hayakawa, and Y. Wakayama, J. Appl. Phys., 121 (2017) 024301

Fig.1 ラマンスペクトルの硫化処理温度依存性 (挿入図) X線回折パターン

Fig.2 硫化処理(900°C)後の電気抵抗の温度依存性 (挿入図) 処理前の VO₂ 薄膜の電気抵抗の温度依存性